



# 大面積Micro Pixel Chamberの開発 6 ～ $\mu$ -PICの大面積化～

京都大学 高田淳史

谷森達, 窪秀利, 身内賢太朗, 竹田敦(ICRR),  
関谷洋之, 永吉勉, 折戸玲子, 植野優,  
岡田葉子, 西村広展, 服部香里

- ◆ 大面積  $\mu$ -PIC
- ◆ 性能評価
- ◆ まとめ



# 大面積 $\mu$ -PICの必要性

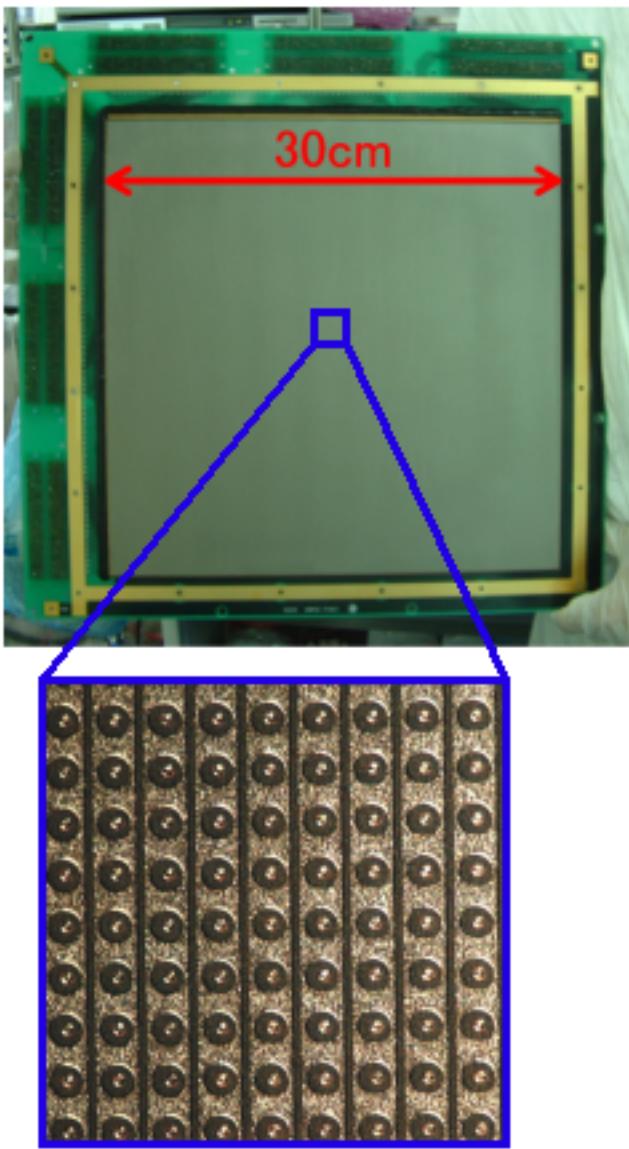
これまで  $\mu$ -PIC(10cm × 10cm)が使われた実験

- MeVカメラ (折戸 24aXK-5)
  - 60keV以上の電子はescape  
⇒ energy unknownなsourceを捕らえるのは非常に難しい
  - 検出効率の向上
- X線結晶解析
  - カバーする立体角を大きく  
⇒ より精確に、より早く
  - 繰ぎ目は嬉しくない
- DM search (関谷 27pXJ-11)
  - とにかく質量を稼ぎたい



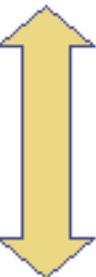
もっと大きな  $\mu$ -PICを!!!

# 30cm角大面積 $\mu$ -PIC



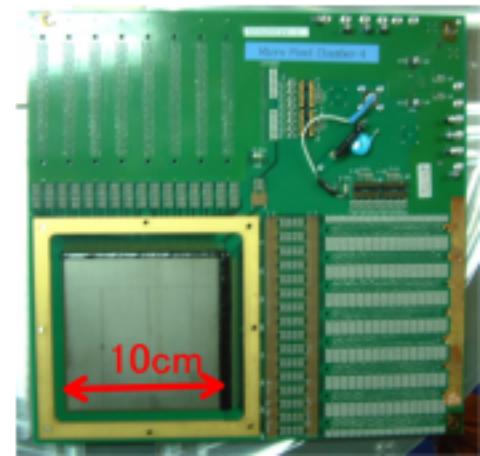
## 30cm角 $\mu$ -PIC

- 2004年12月初めに1号機完成
- pixel数 : 589,824( $=768^2$ )個
- pitch :  $400 \mu\text{m}$
- strip readout
- 検出部面積 :  $\sim 944\text{cm}^2$  ( $\sim 30\text{cm}$ 角)
- 128極DIN connector 12個による出力

 検出面積 9倍  
Read out数 3倍

## 従来の $\mu$ -PIC

- pixel数 : 65,536( $=256^2$ )個
- pitch :  $400 \mu\text{m}$
- 検出部面積 :  $\sim 105\text{cm}^2$



# Pixelの形成方法

1. Electroless plating



2. Via-fill plating



3. Surface etching



4. Electrode etching



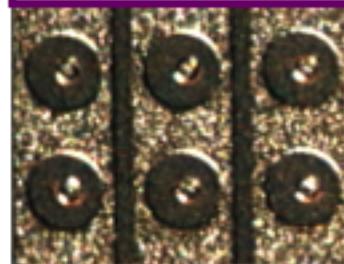
1. 無電解めっきによるめっきseedの形成
2. ビアフィルめっきで基板より上までめっき
3. 表面の平滑化
4. エッティングによる電極形成

10cm角  $\mu$ -PICと同じ方法でpixelを形成

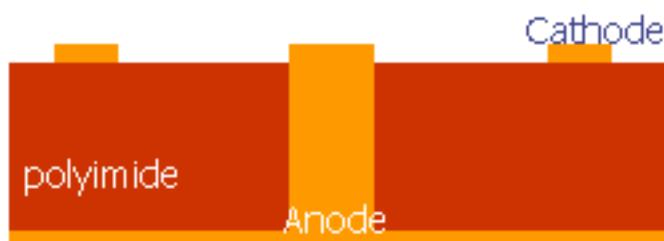
# 30cm角 $\mu$ -PICのpixel形状

Dead pixel存在比

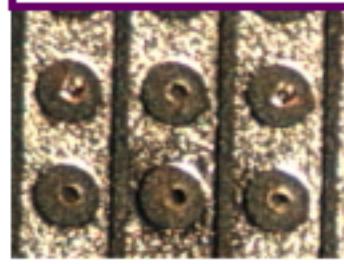
Good pixel



Anodeが基板表面より  
上に出ている



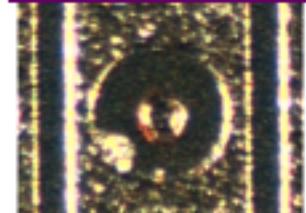
Dead pixel



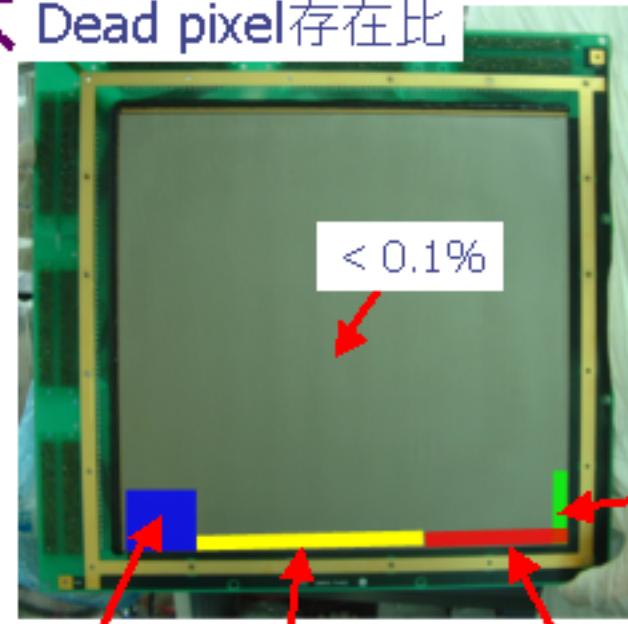
Anodeの形成不良  
⇒ 特に悪さはしない  
全面で~1%程度



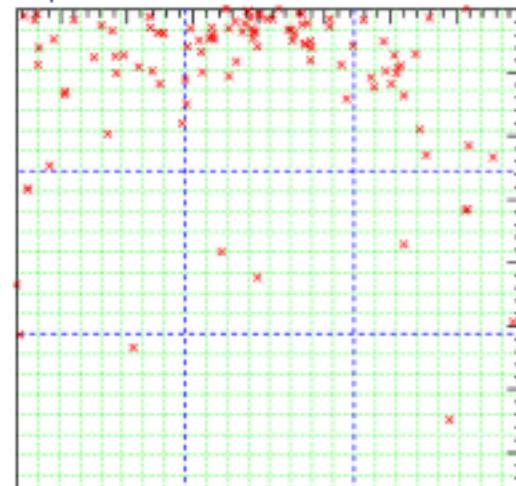
Bad pixel



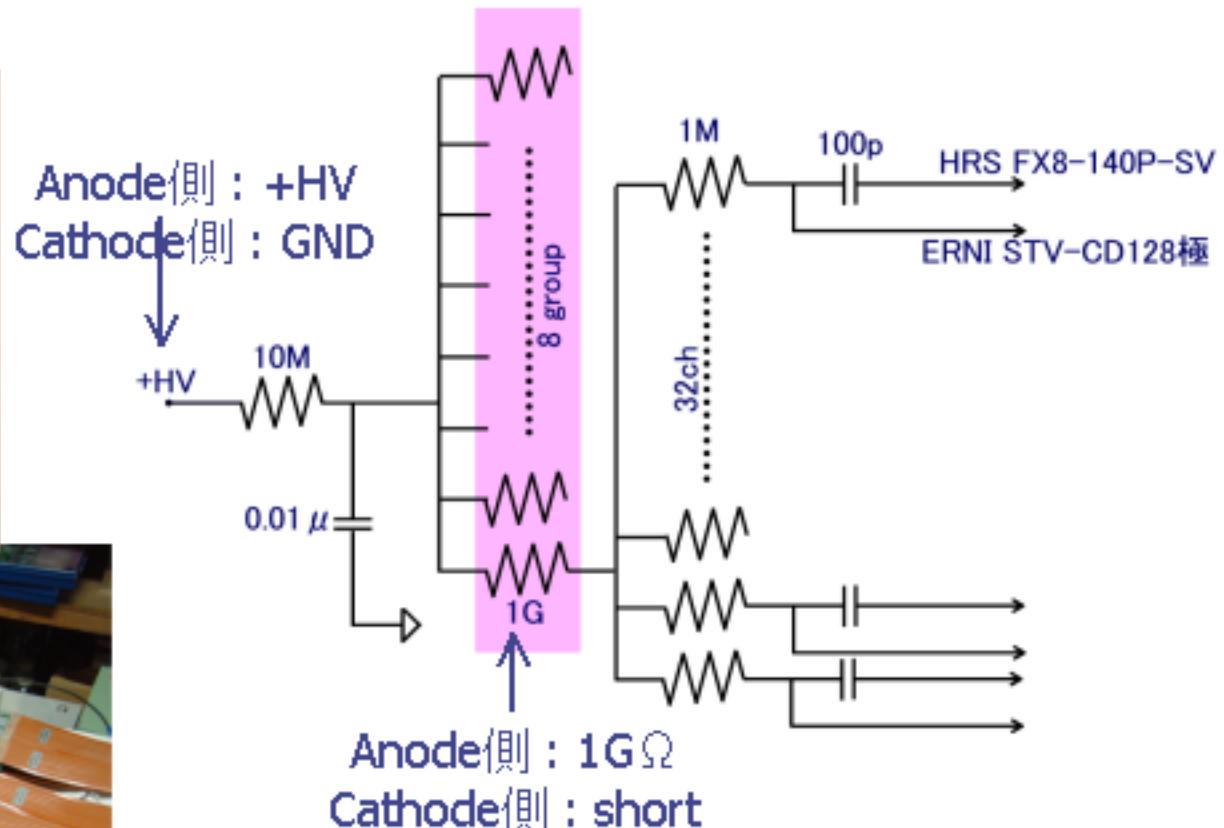
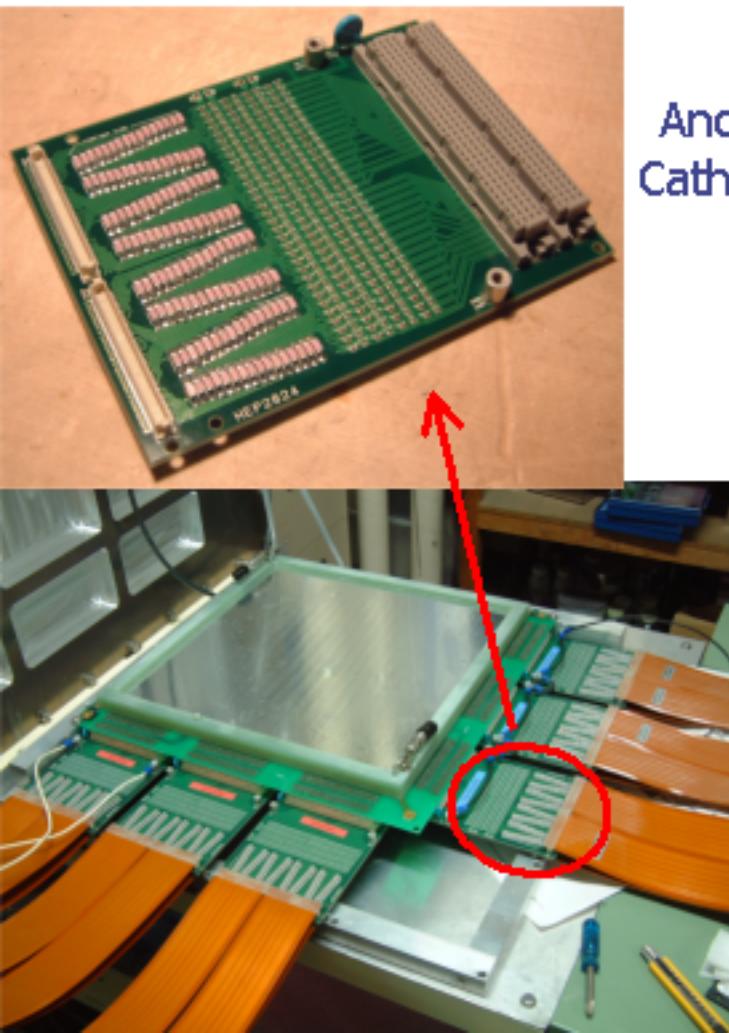
電極形状不良  
⇒ 放電の原因  
一部に固まって存在  
全面で>0.02%



Bad pixel分布

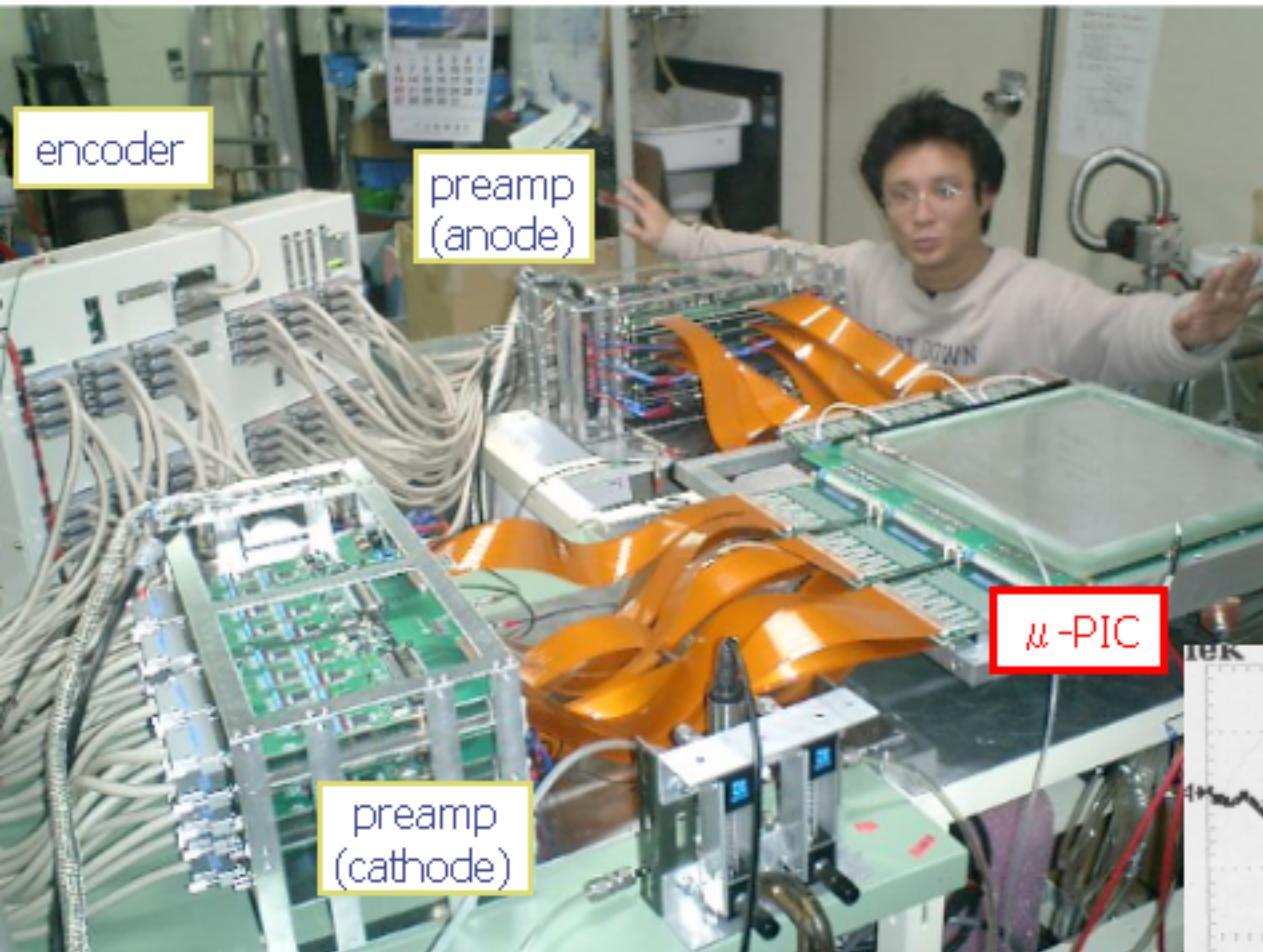


# 30cm角 $\mu$ -PIC動作用回路



- 1枚で256chに電圧供給
- anode/cathodeともほぼ同じ

# Setup & First signal



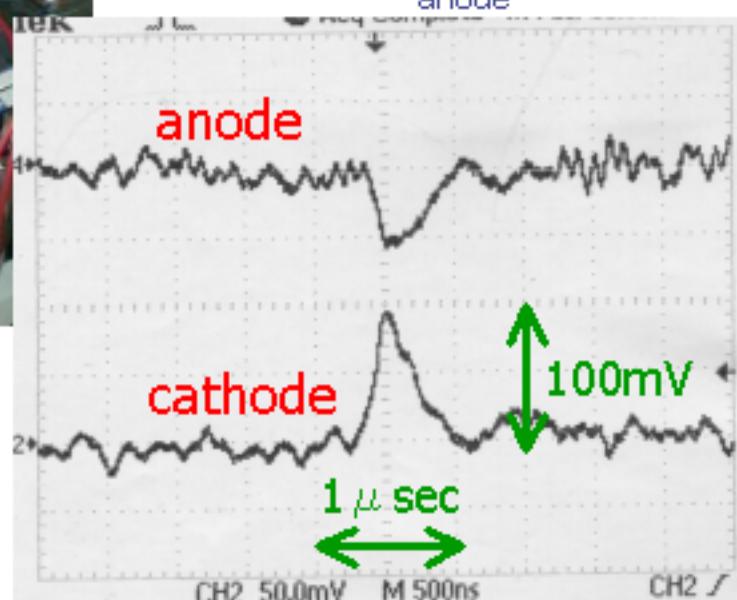
Anode/Cathode共に信号を確認

## Setup

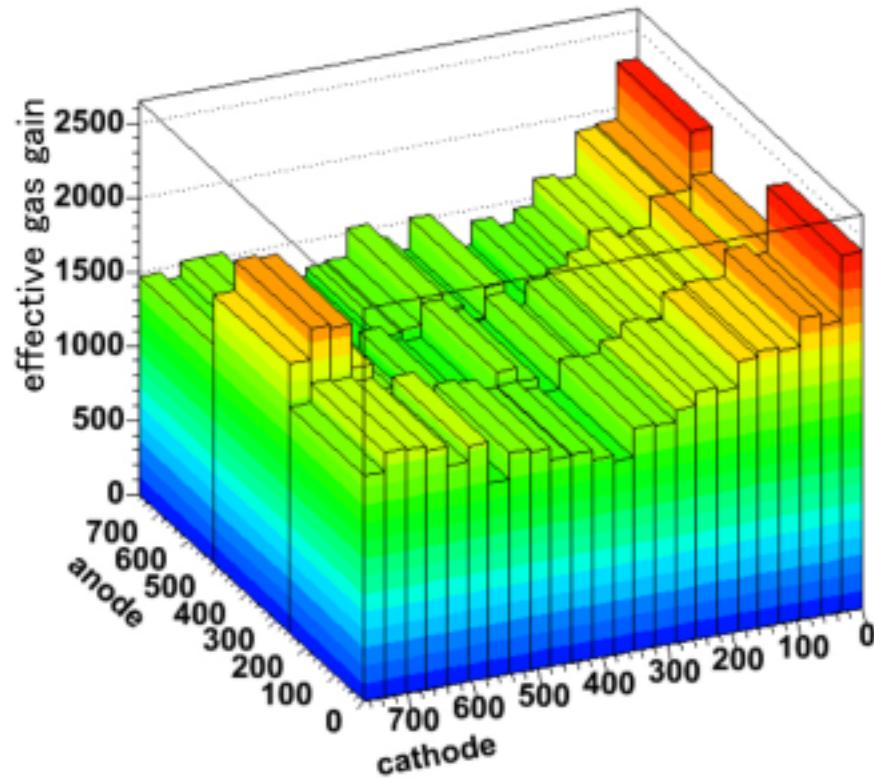
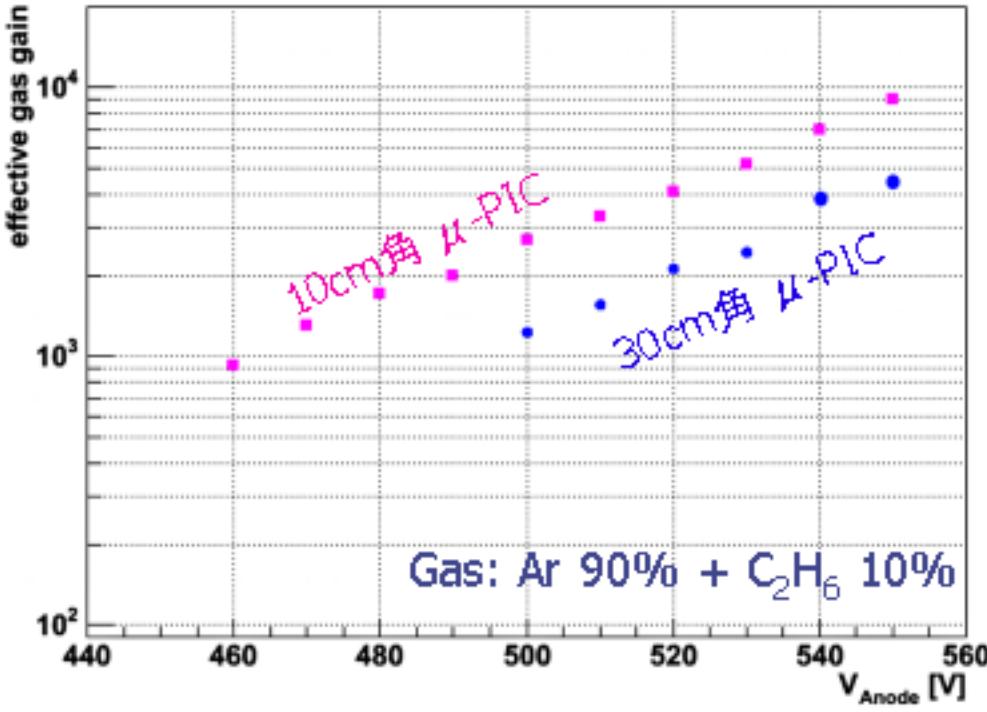
- フレキ基板(50cm)による  
信号引出し
- ASD chip (80nsec)

## First signal

gas : Ar 90% + C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> 10%  
src : <sup>90</sup>Sr V<sub>anode</sub> : 500V

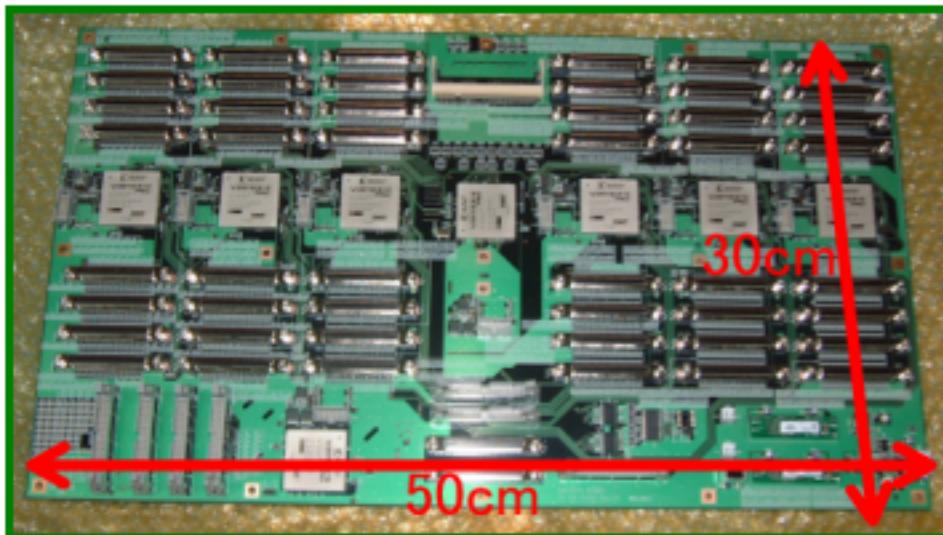


# Gas gain

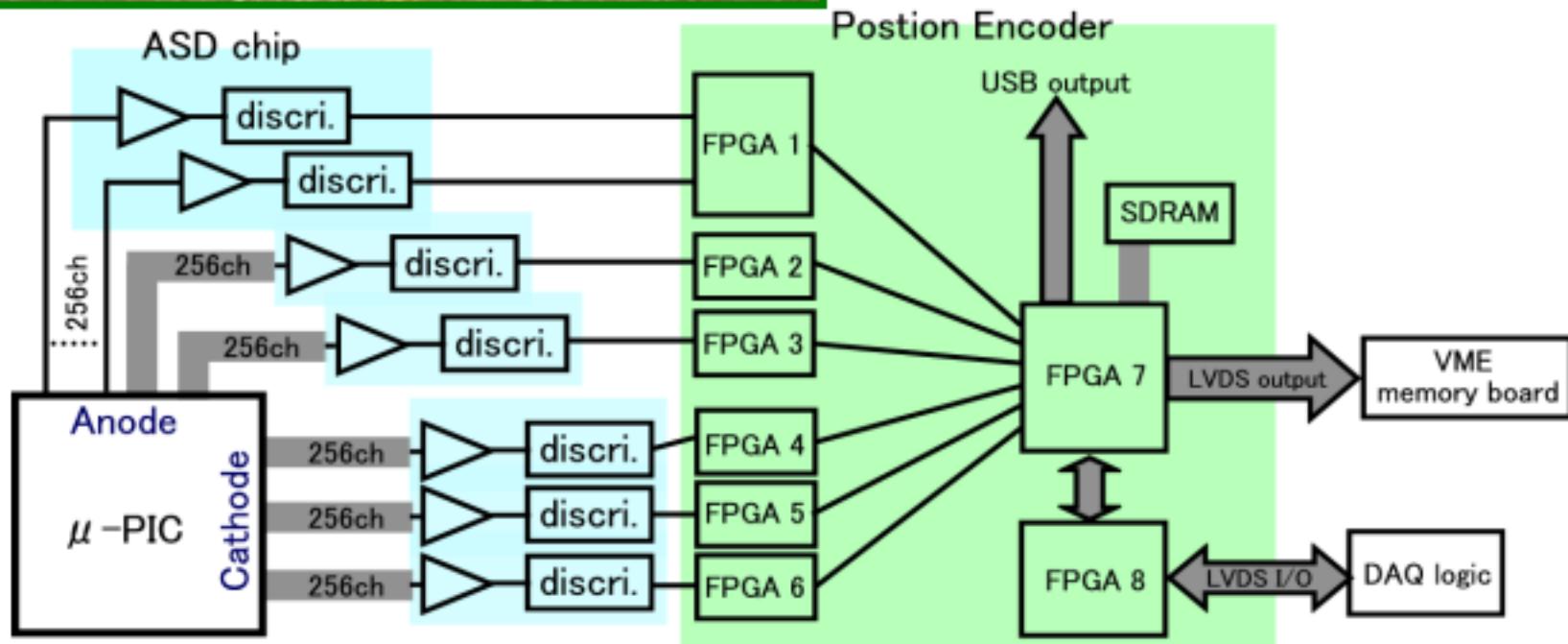


- gas gainは従来の  $\mu$ -PICに対して約1/2  
    ⇒ 読出しフレキ基板による信号減衰が原因
- gainの場所依存性  
    Min:Max = 1:2.2, RMS/Mean = 16.7%
- 外周部のgas gainが高め

# 30cm $\mu$ -PIC用Encoder



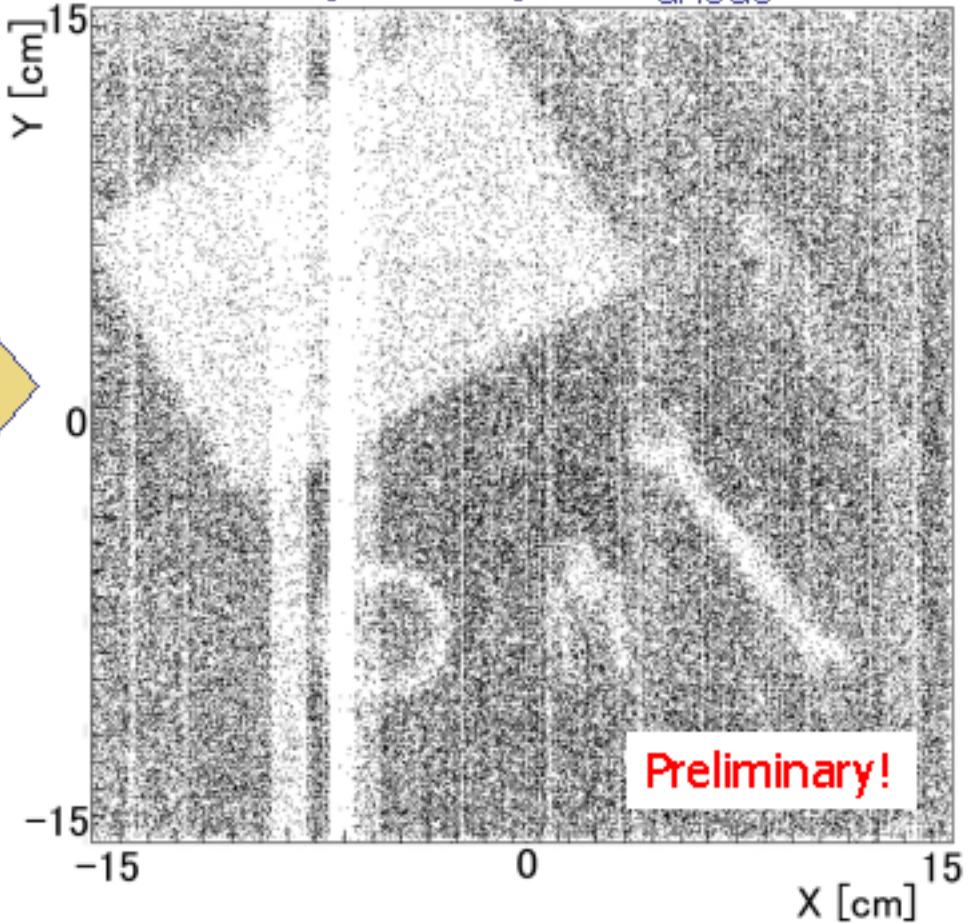
- 2004年11月完成
- 1536ch LCDS入力
- 100MHzのclockで動作
- 8つのFPGAによるpipeline処理
- 多彩なoption付  
USB output, SDRAM, etc.



# X線imaging



Gas: Ar 90% + C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> 10% (~1cm)  
Src: <sup>109</sup>Cd(22keV) V<sub>anode</sub>: 510V



30cm角  $\mu$ -PICとEncoderを用いてのX線imagingに成功!!!

# まとめ

- 30cm角の大面積  $\mu$ -PICを作成
- Position Encoderを作成
- 端のほうで一部Anode不良が見られる
- 大面積  $\mu$ -PICからの信号を確認
- X線imagingに成功
- Pulse heightは従来の  $\mu$ -PICの約半分  
    ⇒ 信号読出しの部分に問題あり
- 外周部でgainがやや高くなる傾向がある



## Future work

- spectrumの取得
- Drift cageを取り付けTPCとしての動作確認
- 読出し回路の改善
- GEMを取り付けての動作確認

